

# Presse-Information

Datum: Juli 2020  
Anlage: jpg.  
Kennziffer: PR-0020-CPE-220720-IRIS

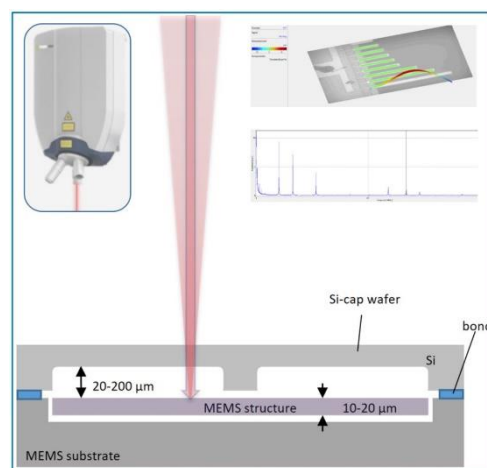
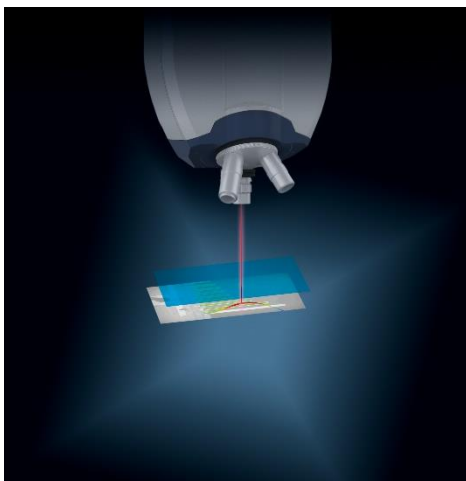
## Mit patentierter Schwingungsmesstechnologie: Polytec prüft verkapselte MEMS als Dienstleistung

Für die präzise Untersuchung der Dynamik von MEMS und anderen Mikrostrukturen hat sich die Laser-Doppler-Vibrometrie (LDV) etabliert. Da sie aber typischerweise mit sichtbaren Wellenlängen arbeitet, kann sie die Siliziumverkapselung von MEMS nicht durchdringen und damit verkapselte MEMS auch nicht direkt untersuchen. Polytec bietet die patentierte Lösung: Die Charakterisierung mit Lichtquellen im nahinfraroten Bereich erlaubt es, die Kapsel eines solchen MEMS zu durchdringen und zu vermessen, ohne sie öffnen zu müssen. Denn Silizium ist im nahen Infrarotspektrum oberhalb von Wellenlängen von 1050 nm transparent. Die auf Infrarot-Interferometern basierende Schwingungsmesstechnologie von Polytec misst auf reales Schwingverhalten, liefert repräsentative Ergebnisse und bietet höchste Datenqualität aufgrund der expliziten Trennung der einzelnen Bauteilschichten (layer) in verkapselten MEMS.

Mit den Messdienstleistungen bei Polytec können Kunden die Technologie nutzen, auch wenn sie kein eigenes Messsystem besitzen, und experimentelle Modalanalysen, Machbarkeitsstudien und Beratung in sämtlichen Projektphasen beauftragen.

Weitere Informationen zum Produkt finden unter folgendem Link:

<https://www.polytec.com/de/vibrometrie/produkte/mikroskopbasierte-vibrometer/msa-iris-messdienstleistung/>



Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen  
Christina Petzhold  
Tel. 07243-604-3680